PATENT APPLICATION - ++ > LW 3-23-10

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Yasunao MIURA et al.

Application No.:

10/045,085

Filed: January 15, 2002

For:

METHOD OF FABRICATING HONEYCOMB BODY AND DRYING SYSTEM

Docket No.:

111658

CLAIM FOR PRIORITY

Director of the U.S. Patent and Trademark Office Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign applications filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2001-007930 filed January 16, 2001; Japanese Patent Application No. 2001-370393 filed December 4, 2001; and Japanese Patent Application No. 2001-370394 filed December 4, 2001. In support of this claim, certified copies of said original foreign applications:

X	are filed herewith.
	were filed on in Parent Application No filed
	will be filed at a later date.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of these documents.

Respectfully submitted,

Joel S. Armstrong Registration No. 36,430

JAO:JSA/zmc

Date: February 25, 2002

OLIFF & BERRIDGE, PLC P.O. Box 19928 Alexandria, Virginia 22320 Telephone: (703) 836-6400

DEPOSIT ACCOUNT USE **AUTHORIZATION** Please grant any extension necessary for entry; Charge any fee due to our Deposit Account No. 15-0461

日本 国 特 許 庁 O JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されるいる事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であると呼ぎ証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

: 2001年12月 4日

出 願 番 号

Application Number: 特願2001-370394

[ST.10/C]:

[JP2001-370394]

出願、人

Applicant(s): 株式会社デンソー

2002年 1月18日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



特2001-370394

【書類名】

【整理番号】 N-76190

【提出日】 平成13年12月 4日

特許願

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B28B 11/10

【発明の名称】 ハニカム成形体の製造方法及び乾燥装置

【請求項の数】 9

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】 三浦 康直

【特許出願人】

[識別番号] 000004260

【氏名又は名称】 株式会社デンソー

【代理人】

【識別番号】 100079142

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 祥泰

【選任した代理人】

【識別番号】 100110700

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩倉 民芳

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2001- 7930

【出願日】 平成13年 1月16日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009276

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

特2001-370394

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0105519

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】 ハニカム成形体の製造方法及び乾燥装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 厚さ0.125mm以下のセル壁をハニカム状に配して多数のセルを設けたセラミック製のハニカム成形体を製造する方法において,

押出成形された粘土質のハニカム成形体を乾燥するに当たり、該ハニカム成形体を湿度が70%以上の高温度雰囲気に晒すと共に、周波数1000~1000 OMHz領域のマイクロ波を照射して乾燥した後、

上記ハニカム成形体に対して、上記セルを通過するように熱風を当てることを 特徴とするハニカム成形体の製造方法。

【請求項2】 請求項1において、上記熱風の温度が50~140℃であることを特徴とするハニカム成形体の製造方法。

【請求項3】 請求項1又は2において、上記ハニカム成形体を乾燥するに当たり、上記マイクロ波の照射により上記ハニカム成形体の水分含有量を重量比5~30%とした後、上記熱風を当てることを特徴とするハニカム成形体の製造方法。

【請求項4】 請求項1~3のいずれか1項において,上記ハニカム成形体を乾燥するに当たり,上記ハニカム成形体に対して,上記熱風を当てた後に,さらに冷風を当てることを特徴とするハニカム成形体の製造方法。

【請求項5】 請求項4において、上記冷風の温度が0~30℃であることを特徴とするハニカム成形体の製造方法。

【請求項6】 厚さ0.125mm以下のセル壁をハニカム状に配して多数のセルを設けたセラミック製のハニカム成形体を製造するに当たり、押出成形された粘土質のハニカム成形体を乾燥する乾燥装置であって、

上記ハニカム成形体を収納する乾燥槽と,

該乾燥槽内を湿度が70%以上の高湿度雰囲気とする加湿装置と,

周波数1000~10000MHェ領域のマイクロ波を上記乾燥槽内に供給するマイクロ波発生装置と,

上記乾燥槽の内部又は外部において上記ハニカム成形体に当てる熱風を発生す

る熱風発生装置を有することを特徴とするハニカム成形体の乾燥装置。

【請求項7】 請求項6において、上記熱風発生装置は、温度が50~14 0℃である熱風を発生する熱風発生源を有していることを特徴とするハニカム成 形体の乾燥装置。

【請求項8】 請求項6又は7において、上記乾燥装置は、上記乾燥槽の内部又は外部において上記ハニカム成形体に当てる冷風を発生する冷風発生装置を有していることを特徴とするハニカム成形体の乾燥装置。

【請求項9】 請求項8において、上記冷風発生装置は、温度が0~30℃ である冷風を発生する冷風発生源を有していることを特徴とするハニカム成形体の乾燥装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】

本発明は、ハニカム成形体の製造方法、特にその乾燥工程および乾燥装置に関する。

[0002]

【従来技術】

セラミック製のハニカム成形体を製造するに当たっては、粘土質のハニカム成形体を押出成形し、これを乾燥した後、焼成する。ハニカム成形体の乾燥方法としては、例えば特開昭63-166745号公報に示されているように、ハニカム成形体の上方及び下方に配置した電極間に電流を流して発生させた高周波を用いる方法が知られている。この方法は、ハニカム成形体の内外を均一に加熱し、乾燥速度差により生じる収縮量差が原因となる外周スキン部の割れ、しわ等の欠陥の発生を防止しようとするものである。

[0003]

【解決しようとする課題】

上記乾燥方法は、従来自動車の排ガス浄化装置の触媒担体として一般的に用いられてきたセル壁厚さ 0. $30\sim0$. $15\,\mathrm{mm}$, 外周スキン部の厚さ 0. $3\sim1$. $0\,\mathrm{mm}$ のハニカム成形体に対しては有効である。しかしながら、近年の排気ガ

ス浄化性能向上等のニーズにより開発されてきたセル壁厚さが 0. 1 2 5 mm以下で、外周スキン部の厚さが 0. 5 mm以下の薄壁品においては、セル壁自身の強度および外周スキン部自身の強度が従来よりも低い。そのため、この薄壁品においては、従来の高周波を用いた方法では、外周スキン部の欠陥発生に対する十分な対策が困難となってきた。

[0004]

本発明はかかる従来の問題点に鑑みてなされたもので、セル壁厚さが0.125mm以下のハニカム成形体を、外周スキン部に割れ、しわ等の欠陥を生じさせることなく乾燥することができるハニカム成形体の製造方法及び乾燥装置を提供しようとするものである。

[0005]

【課題の解決手段】

請求項1の発明は、厚さ0.125mm以下のセル壁をハニカム状に配して多数のセルを設けたセラミック製のハニカム成形体を製造する方法において、押出成形された粘土質のハニカム成形体を乾燥するに当たり、該ハニカム成形体を湿度が70%以上の高温度雰囲気に晒すと共に、周波数1000~1000MHz領域のマイクロ波を照射して乾燥した後、上記ハニカム成形体に対して、上記セルを通過するように熱風を当てることを特徴とするハニカム成形体の製造方法にある。

[0006]

本発明の製造方法においては、上記のごとく、湿度が70%以上という高湿度雰囲気において上記ハニカム成形体を加熱する。これにより、ハニカム成形体の外周表面が変形するような急激な乾燥を防止して外周表面を適度な湿度に保つことができる。これにより、外周表面と内部との乾燥速度差を低減することができる。そのため、セル壁厚さが0.125mm以下と薄く、外周スキン部の厚みも比較的薄い場合においても、ハニカム成形体の内外の乾燥速度差による収縮量差を小さくすることができる。それ故、外周スキン部の割れ、しわ等の欠陥を防止することができる。上記高湿度雰囲気の湿度としては高いほどより好ましく、80%以上、あるいは過飽和状態でもよい。

[0007]

また、本発明においては、上記加熱の手段として、上記マイクロ波を用いる。 これにより、上記高湿度雰囲気での加熱を実現することができる。すなわち、従来の高周波による加熱の場合、ハニカム成形体の近傍に電極を配置する必要がある。この電極を高湿度雰囲気内に配置すれば、電極間で放電や絶縁破壊を起こし、電極破損による設備故障が生じるおそれがある。

[0008]

これに対し、上記マイクロ波は、導波管を通じて導くことが可能であり、被加熱物の近傍に電極を設ける必要がない。そのため、マイクロ波は、上記高湿度雰囲気においても容易にハニカム成形体に到達し、これを加熱することができる。

このように、本発明では、マイクロ波加熱と高湿度雰囲気との組合せによって、セル壁厚さが 0. 1 2 5 mmと非常に薄く、外周スキン部も比較的薄い場合においても、乾燥時の外周スキン部の割れやしわの発生を十分に防止することができる。そして、この乾燥時の品質向上によって、その後の焼成工程を経て得られる焼成品としてのハニカム成形体を優れた品質とすることができる。

[0009]

さらに,本発明においては,上記高湿度雰囲気でのマイクロ波による乾燥後, 上記ハニカム成形体に対して,上記セルを通過するように熱風を当てる。

この場合には、上記高湿度雰囲気でのマイクロ波加熱の制御を容易にすることができ、マイクロ波加熱による、ハニカム成形体の過剰な加熱を防止することができる。そして、過剰加熱のおそれのない温度の熱風によって精度のよい完全乾燥を実現することができる。

なお、上記の完全乾燥とは、およそ、ハニカム成形体の水分含有量が初期の5 %以下となった場合をいう。

[0010]

次に,請求項2の発明のように,上記熱風の温度が50~140℃であることが好ましい。上記熱風の温度は上記作用効果を得るために制限されるものではなく,任意の温度を採用することができる。しかし,上記熱風が50℃未満である場合には,上記ハニカム成形体の温度が下がり過ぎて,乾燥効率が低下するおそ

れがある。また、上記熱風が140℃を超える場合には、急激な乾燥の進行により上記ハニカム成形体にトラブルが発生するおそれがある。

[0011]

また、請求項3の発明のように、上記ハニカム成形体を乾燥するに当たり、上記マイクロ波の照射により上記ハニカム成形体の水分含有量を重量比5~30%とした後、上記熱風を当てることが好ましい。

上記マイクロ波を照射した後の上記ハニカム成形体の水分含有量は,上記作用効果を得るために制限されるものではなく,上記マイクロ波加熱と上記熱風乾燥を組み合わせることによって一定の作用効果を得ることができる。

[0012]

しかし、上記マイクロ波照射した後の上記ハニカム成形体の水分含有量が5%未満とする場合には、上記マイクロ波加熱する際の制御が難しくなる。そして、上記マイクロ波の照射ムラ等によって、上記ハニカム成形体の一部が過剰過熱するおそれがある。また、上記ハニカム成形体の水分含有量が30%を超える場合には、その後、上記ハニカム成形体に熱風を当てても、完全乾燥状態に達し得ないおそれがある。

なお,より好ましくは,上記ハニカム成形体中の水分の10~20%がまだ残存する程度までの乾燥を上記高湿度雰囲気でのマイクロ波加熱により行い,その後,熱風により完全乾燥を行うのが良い。

[0013]

また,請求項4の発明のように,上記ハニカム成形体を乾燥するに当たり,上記ハニカム成形体に対して,上記熱風を当てた後に,さらに冷風を当てることが好ましい。上記のごとく,ハニカム成形体を乾燥した後の取り扱い容易性を考慮すれば,上記ハニカム成形体を室温まで冷却するのが良い。その際,上記ハニカム成形体に冷風を当てると,より効率的に冷却することができる。

[0014]

特に、上記熱風乾燥後のハニカム成形体について、端面の切り落とし作業を実施する場合に有効である。上記ハニカム成形体が高温である場合には、上記切り落とし時の切り粉粉末が再付着してしまう問題があるからである。

[0015]

また、請求項5の発明のように、上記冷風の温度が0~30℃であることが好ましい。上記冷風の温度は、上記作用効果を得るために制限されるものではない。しかし、上記冷風の温度が、0℃未満である場合には、上記ハニカム成形体が急激に冷却され、上記外周スキン部等にトラブルを発生するおそれがある。また、上記冷風の温度が30℃を超える場合には、効率良く、上記ハニカム成形体を冷却することができない。

[0016]

次に、請求項6の発明は、厚さ0.125mm以下のセル壁をハニカム状に配して多数のセルを設けたセラミック製のハニカム成形体を製造するに当たり、押出成形された粘土質のハニカム成形体を乾燥する乾燥装置であって、上記ハニカム成形体を収納する乾燥槽と、該乾燥槽内を湿度が70%以上の高湿度雰囲気とする加湿装置と、周波数1000~1000MHz領域のマイクロ波を上記乾燥槽内に供給するマイクロ波発生装置と、上記乾燥槽の内部又は外部において上記ハニカム成形体に当てる熱風を発生する熱風発生装置を有することを特徴とするハニカム成形体の乾燥装置である。

[0017]

本発明の乾燥装置を用いれば、上記製造方法における乾燥を容易に実現することができ、品質に優れたハニカム成形体を製造することができる。すなわち、上記乾燥槽内に乾燥すべきハニカム成形体を配置し、上記加湿装置によって乾燥槽内の湿度を70%以上に高めることにより高湿度雰囲気を形成する。そして、上記マイクロ波発生装置からマイクロ波を導入することにより、ハニカム成形体をマイクロ波加熱することができる。これにより、外周スキン部に割れやしわを発生させずにハニカム成形体を乾燥させることができる。

[0018]

さらに、上記乾燥槽の内部又は外部において、上記熱風発生装置が送出する熱風を上記ハニカム成形体に当てることにより、上述した高湿度雰囲気でのマイクロ波加熱と、熱風による加熱との組合せによる乾燥を容易に行うことができる。 上述したごとく、この場合には、上記高湿度雰囲気でのマイクロ波加熱の制御を 容易にすることができ、マイクロ波過熱によるトラブルを未然に防止することができる。そして、過剰加熱のおそれのない温度の熱風によって精度のよい上記完全乾燥を実現することができる。

なお,上記乾燥装置は,ハニカム成形体を乾燥槽に対して順次連続的に搬入・ 搬出する連続装置としてもよいし,バッチ型の装置としてもよい。

[0019]

また、請求項7の発明のように、上記熱風発生装置は、温度が50~140℃ である熱風を発生する熱風発生源を有していることが好ましい。上記温度範囲に よる熱風によれば、上記のごとく、上記ハニカム成形体を効率良く、外周スキン 部等のトラブルを回避しながら乾燥することができる。

[0020]

また、請求項8の発明のように、上記乾燥装置は、上記乾燥槽の内部又は外部において上記ハニカム成形体に当てる冷風を発生する冷風発生装置を有していることが好ましい。この場合には、上記熱風乾燥後のハニカム成形体を、速やかに冷却することができる。そのため、上記乾燥工程以降の工程を安全かつ速やかに実施することができる。特に、上記のごとく、上記ハニカム成形体が冷却されていれば、両端面の切り落とし作業を実施する際、切り粉粉末が再付着するのを十分防止することができる。

[0021]

また、請求項9の発明のように、上記冷風発生装置は、温度が0~30℃である冷風を発生する冷風発生源を有していることが好ましい。上記温度範囲にある冷風によれば、上記のごとく、上記ハニカム成形体を効率的良く、外周スキン部等のトラブルを回避しながら冷却することができる。

[0022]

【発明の実施の形態】

実施形態例1

本発明の実施形態例にかかるハニカム成形体の製造方法及び乾燥装置につき, 図1,図2を用いて説明する。

本例は、図2に示すごとく、厚さt1が0.125mm以下のセル壁11をハ

二カム状に配して多数のセル10を設けたセラミック製のハニカム成形体1を製造する方法である。本例のハニカム成形体1は、同図に示すごとく、四角形のセル10を有し、厚さt2が0.5mm以下の円筒状の外周スキン部12を有する形状を呈している。なお、上記セル形状、全体形状は用途に合わせて変更可能である。

[0023]

本例の方法では、押出成形された粘土質のハニカム成形体1を乾燥するに当たり、ハニカム成形体1を湿度が70%以上の高湿度雰囲気に晒すと共に、周波数1000~1000MHz領域のマイクロ波を照射する。そして、その後、上記ハニカム成形体に対して、上記セルを通過するように熱風を当てる。以下、この内容について詳しく説明する。

[0024]

本例のハニカム成形体1を製造するに当たっては、まず、主にコーディエライトとなるセラミック原料粉100重量部に対して、有機バインダー5重量部と、水15重量部とを添加して混練し、粘土状のセラミック原料を作製した。

次に、このセラミック原料を押出成形機(図示略)を用いてハニカム成形型より押し出すと共に順次所定長さに切断し、粘土状のハニカム成形体1を成形した。上記押出成形機としては、プランジャー式、オーガ式等がある。

また、本例ではハニカム成形型のセル壁部のスリット幅を0.115mm,外周スキン部のスリット幅を0.3mmとした。

[0025]

次に,上記押出成形により得られた薄壁のハニカム成形体1を図1に示す乾燥 装置3を用いて乾燥した。

乾燥装置3は、同図に示すごとく、上記ハニカム成形体1を収納する乾燥槽3 0と、該乾燥槽30内を湿度が70%以上の高湿度雰囲気とする加湿装置32と 、周波数1000~1000MHz領域のマイクロ波を上記乾燥槽30内に供 給するマイクロ波発生装置34と、上記マイクロ波を照射後の上記ハニカム成形 体1に当てる熱風を発生する熱風発生装置37とを有する。

[0026]

上記乾燥槽30は,後述する搬送装置4により運搬されるハニカム成形体1を 複数個分を収納できる大きさを有している。

そして、一方の側壁303の前後上下の4角部分に、4つのマイクロ波発生装置34からそれぞれ延設された導波管340が接続されて開口している。この開口部がマイクロ波導入口341である。

[0027]

また、側壁303の前後2カ所には、加湿装置32としてのボイラーから延設され分岐した2本の蒸気配管320が接続され開口している。この開口部が蒸気導入口321から導入される蒸気は、上記のごとくボイラーより送られる高温蒸気であり、その温度は80℃以上である。

[0028]

さらに、上記熱風発生装置36は、上記乾燥槽30の外部で上記ローラコンベア42の下に配設してある。この熱風発生装置36は、上記ローラコンベア42 上を移動してくる搬送トレイ5に対して、鉛直方向に120℃の熱風を吹き上げるよう構成されている。この温度は上記ハニカム成形体1が含有するバインダが燃焼しない温度である。

[0029]

また本例の乾燥装置3は、上記乾燥装置は、上記ハニカム成形体を搬送する搬送装置4を有しており、複数のハニカム成形体1を連続的に乾燥槽30に搬入・搬出できるよう構成された連続装置となっている。

具体的には、乾燥槽30内には、その入口部301と出口部302とを結ぶようにベルトコンベア41が配設されている。また、乾燥槽30の出口側外部には、ローラコンベア42が配設されている。

[0030]

そして、これらベルトコンベア41及びローラコンベア42よりなる搬送装置4は、ハニカム成形体1を載置した搬送トレイ5を搬送するよう構成されている。本例では、搬送トレイ5として、誘電損失が0.1以下、気孔率が10%以上、断面開口面積比が50%以上の多孔質のセラミックス、本例ではコーディエライト製のものを使用した。なお、この材質は、尿素樹脂、その他のものに変更す

ることもできる。また、搬送トレイ5上においては、ハニカム成形体1のセル10の開口端面の一方(101)を上記搬送トレイ5の上面51に当接させて載置した。これにより、各ハニカム成形体1は、そのセル10が鉛直方向に向くと共に、搬送トレイ5の気孔と連通状態となる。

[0031]

このような構成の乾燥装置3を用いて、上記のごとく押出成形されたハニカム 成形体1を乾燥するに当たっては、まず、図1に示すごとく、所定長さに切断された各ハニカム成形体1を搬送トレイ5上に載置して順次ベルトコンベア41上 に載せる。これにより、各ハニカム成形体1は、順次乾燥槽30内に搬入されていく。

[0032]

乾燥槽30内に送入された各ハ二カム成形体1は、ベルトコンベア41の動きに伴って、入口部301側から出口部302側に移動しながら乾燥されていく。

ここで、乾燥槽30内は、上記加湿装置32から導入される高温蒸気によって湿度が70%以上(本例では80%以上)、温度が80℃以上の高湿度雰囲気となっていると共に、上記マイクロ波発生装置34から発せられるマイクロ波が導入されている。そのため、乾燥槽30内のハニカム成形体1は、外周スキン部12の割れやしわの発生を防止しつつ急速に乾燥される。

[0033]

すなわち、上記乾燥槽30が上記のごとく高温の高温度雰囲気となっているので、ハニカム成形体1が加熱される際に、外周表面が変形するような急激な乾燥が防止され、適度な湿度に保たれる。そのため、外周表面と内部との乾燥速度差を低減することができる。そのため、セル壁厚さが0.125mm以下と薄い本例のハニカム成形体1であっても、その内外の乾燥速度差による収縮量差を小さくすることができる。それ故、外周スキン部12の割れ、しわ等の欠陥を防止することができる。

[0034]

また、本例においては、上記加熱の手段として、上記マイクロ波を用いる。マイクロ波は、上記乾燥槽30内が上記のような高湿度雰囲気となっていても、導

波管70を介して容易に導入できる。そのため、複雑な設備構成をとることなく 、ハニカム成形体1を容易に誘電加熱することができる。

このように、本例では、マイクロ波加熱と高温度雰囲気との組合せによって、セル壁厚さが0.125mm以下、外周スキン部の厚さが0.3mm以下の薄肉品である場合においても、乾燥時の外周スキン部12の割れやしわの発生を十分に防止することができる。

[0035]

更に、本例では、上記乾燥槽30内での高湿度雰囲気でのマイクロ波による乾燥後、ハニカム成形体1に対して、上記熱風発生装置36から発する熱風をセル10を通過するように当てる。すなわち、本例では、ハニカム成形体1の乾燥を高湿度雰囲気でのマイクロ波加熱と熱風による加熱との組合せにより行う。具体的には、乾燥前のハニカム成形体中の水分の10~20%がまだ残存する程度までの乾燥を上記高湿度雰囲気でのマイクロ波加熱により行い、その後、水分含有量が5%以下となるように熱風により完全乾燥を行う。

[0036]

これにより、上記高湿度雰囲気でのマイクロ波加熱の制御を容易にすることができ、マイクロ波加熱の過剰加熱によってハニカム成形体のバインダー成分が焼失するなどの不具合を防止することができる。そして、過剰加熱のおそれのない温度の熱風によって精度のよい完全乾燥を実現することができる。

[0037]

また、本例の乾燥装置4は、上記のごとく搬送装置4を有し、連続操業可能な 構成を有している。そのため、非常に効率よく乾燥工程を行うことができる。

また、本例の搬送トレイ5は、上記のごとく誘電損失が0.1以下、気孔率が10%以上、断面開口面積比が50%以上の多孔質のコーディエライトという特定のセラミックスを用いている。そのため、上記マイクロ波による乾燥時には、水分の滞留防止、および搬送トレイ5の高温化防止を図ることができる。更に、熱風加熱時には、上記気孔を通した熱風の供給によって、セル10内への熱風の通過を容易に行うことができる。

[0038]

実施形態例2

本例では、実施形態例1における乾燥装置3を用い、その乾燥槽30に導入する高温蒸気量の変化により湿度を変化させ、湿度と外周スキン部の品質との相関を見る実験を行った。湿度以外の条件は実施形態例1と同様とした。

[0039]

実験結果を図3に示す。同図は、横軸を乾燥槽30の槽内湿度、縦軸を外周スキン部の割れ・しわ不良率をとった。各実験は、それぞれ20個のハニカム成形体を処理し、少しでも割れ・しわのあったものを不良品としてその個数の割合を算出して不良率とした。

同図より知られるごとく、湿度を50%より高めることにより割れ・しわ防止効果が現れ、70%以上ではほぼ確実に割れ・しわの防止ができることがわかった。

[0040]

実施形態例3

本例では、実施形態例1における搬送トレイ5の気孔率を変化させると共に、 上記と同様に乾燥槽30内の湿度を変化させ、乾燥時の水分の滞留による不具合 の有無をみる実験を行った。搬送トレイ5の気孔率および乾燥槽30内の湿度以 外の条件は実施形態例1と同様とした。

[0041]

実験結果を図4に示す。同図は、横軸に搬送トレイの気孔率を、縦軸に乾燥槽30の湿度をとったものである。各条件での処理は一回ずつ行い、少しでもセル壁あるいは外壁スキン部の溶出があった場合をXとし、なかったものをOとして図にプロットした。

同図より知られるごとく、湿度が高いほど溶出しやすくなるが、少なくとも湿度が70%の場合には、搬送トレイの気孔率を10%以上とすることにより溶出を防止することができることがわかる。そして、湿度100%であっても、少なくとも搬送トレイの気孔率を25%以上とすることにより溶出防止を図ることができることもわかる。

[0042]

実施形態例4

本例は、バッチ式の乾燥装置6を用いる例である。

本例の乾燥装置 6 は、図4に示すごとく、ハニカム成形体 1 を収納する乾燥槽 6 0 と、該乾燥槽 6 0 内を湿度が 7 0 %以上の高湿度雰囲気とする加湿装置 6 2 と、周波数 1 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 MHz 領域のマイクロ波を上記乾燥槽 6 0 内に供給するマイクロ波発生装置 6 4 とを有する。

[0043]

上記乾燥槽60内には、搬送トレイ5に載置されたハニカム成形体1を複数個 支持できる受け台68を設けてある。この受け台68は上下方向に貫通する貫通 穴を複数有し通気性を有している。

また、乾燥槽60の一方の側壁603の左右上下の4角部分に、4つのマイクロ波発生装置64からそれぞれ延設された導波管640が接続されて開口している。この開口部がマイクロ波導入口641である。また、乾燥槽60には図示しない入口部を有し、上記ハニカム成形体1を出し入れできるようになっている。

[0044]

また、側壁603の左右2カ所には、加湿装置62としてのボイラーから延設され分岐した2本の蒸気配管620が接続され開口している。この開口部が蒸気導入口621から導入される蒸気は、上記のごとくボイラーより送られる高温蒸気であり、その温度は80℃以上である。

[0045]

そして、本例では、熱風発生装置66を乾燥槽60内に配置した。この熱風発生装置66は、上記受け台68の下方から上方に向けて120℃の熱風を吹き上げるよう構成されている。この熱風は、上記受け台68および搬送トレイ5を貫通してハニカム成形体1のセル10を通過するように流れる。上記搬送トレイ5としては実施形態例1と同様のものを用いる。

[0046]

上記乾燥装置6を用いて成形体1を乾燥するに当たっては、まず、図5に示すごとく、所定長さに切断された複数のハニカム成形体1をそれぞれ搬送トレイ5上に載置し、さらにこれらを上記受け台68上に配置する。そして、この状態で

,乾燥槽60内に加湿装置62から高温蒸気を導入して湿度70%以上の高湿度雰囲気を形成すると共に、マイクロ波発生装置64からマイクロ波を導入してマイクロ波加熱を行う。

[0047]

本例では、ハニカム成形体1の水分が10~20%残存する程度まで上記高湿度雰囲気でのマイクロ波加熱を行う。その後、高温蒸気の導入を停止すると共にマイクロ波の導入を停止する。そして、乾燥槽60内を換気した後、熱風発生装置66から熱風を吹き上げる。これにより、受け台68および搬送トレイ5を通過した熱風が各ハニカム成形体1のセル10を通過する。これにより、ハニカム成形体1の水分含有量が5%以下となる完全乾燥を行う。

[0048]

その後、乾燥槽60からすべてのハニカム成形体1を搬出し、その後、再び乾燥すべきハニカム成形体1を乾燥槽60内に配置することにより、上記一連の乾燥作業を繰り返し行うことができる。

このように、本例では、バッチ式の乾燥装置6を用いても、実施形態例1の連続式の乾燥装置3の場合と同様の優れた乾燥方法を実施することができる。

その他は実施形態例1と同様の作用効果が得られる。

[0049]

実施形態例5

本例は、実施形態例1において、上記熱風乾燥した後の高温のハニカム成形体 1に対して、さらに冷風を当てて冷却した例である。

図6に示すごとく、乾燥装置3を用いて上記乾燥工程を実施した。上記乾燥装置3には、実施形態例1の乾燥装置3を基にして、冷風発生装置37を追加している。具体的には、上記冷風発生装置37を上記熱風発生装置36に隣接して、上記搬送装置4の下流側に配設した。この冷風発生装置36は、上記ローラコンベア42上を移動してくる搬送トレイ5に対して、鉛直方向に15℃の冷風を吹き上げるよう構成されている。

[0050]

本例では、このように構成された上記乾燥装置3を用いて、上記ハニカム成形

14

体1の乾燥工程を実施した。以下、この内容について説明する。

実施形態例1で説明したごとく、上記乾燥装置3に搬入された上記ハニカム成形体1は、マイクロ波を照射され、一定の水分が残留する状態まで乾燥する。その後、上記ハニカム成形体1は、上記熱風発生装置36で発生した熱風を受けて、上記のごとく、完全乾燥する。

[0051]

そして、上記高温のハニカム成形体1は、上記ローラコンベア42上を搬送され、上記冷風発生装置37の位置に到達する。本例では、上記熱風乾燥後のハニカム成形体1に対して、上記冷風発生装置37から発する冷風をセル10を通過するように当てる。すなわち、本例では、マイクロ波加熱と熱風の組み合わせによる乾燥工程に、さらに、冷風による強制冷却を組み合わせた例である。で発生した冷風を当てる。具体的には、上記ハニカム成形体1の温度が、30 ℃以下になるまで冷却した。

[0052]

このように、上記乾燥装置3から搬出される上記ハニカム成形体1は、十分に冷却されている。そのため、上記乾燥装置3から上記ハニカム成形体1を搬出した後、直ちに、その両端面の切り落とし作業を実施した場合であっても、上記ハニカム成形体1に切断時の切り粉粉末が再付着することがない。

したがって、本例によれば、上記乾燥工程からその次の工程への移行時間が短縮化でき、上記ハニカム成形体 1 の製造を効率良く実施することができる。

上記以外の構成及び作用効果については、実施形態例1と同様である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施形態例1における,乾燥装置の構成を示す説明図。

【図2】

実施形態例1における, (a) ハニカム成形体の斜視図, (b) セル壁厚さを示す説明図。

【図3】

実施形態例2における,槽内湿度と割れ・しわ不良率との関係を示す説明図。

【図4】

実施形態例3における、搬送トレイ及び槽内湿度とハニカム成形体の溶出との 関係を示す説明図。

【図5】

実施形態例4における,乾燥装置の構成を示す説明図。

【図6】

実施形態例5における,乾燥装置の構成を示す説明図。

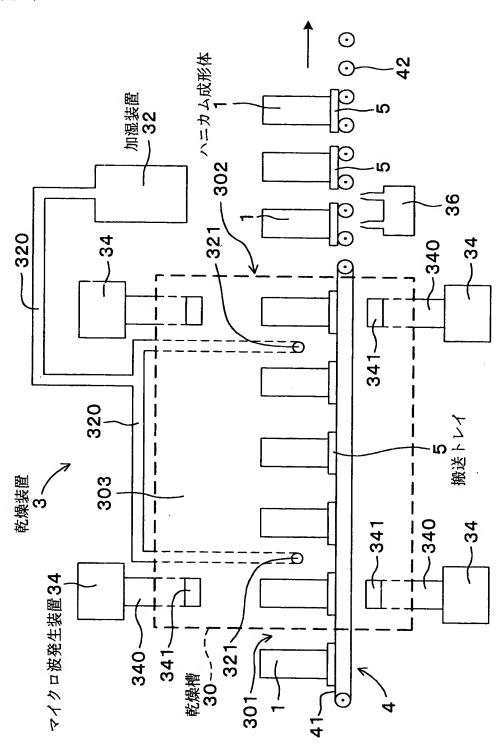
【符号の説明】

- 1... ハニカム成形体,
- 10...セル,
- 11...セル壁,
- 12...外周スキン部,
 - 3, 6... 乾燥装置,
- 30,60...乾燥槽,
- 32.62...加湿装置,
- 320,620...蒸気配管,
- 321,621...蒸気導入口,
 - 34,64...マイクロ波発生装置,
- 340,640... 導波管,
- 341,641...マイクロ波導入口,
 - 36,66... 熱風発生装置,
 - 37...冷風発生装置,
 - 4... 搬送装置,
 - 41...ベルトコンベア,
 - 42...ローラコンベア,
 - 5... 搬送トレイ,

【書類名】 図面

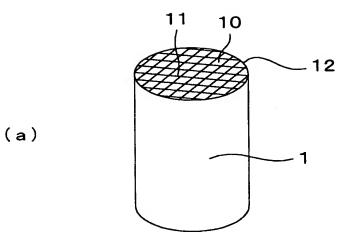
【図1】

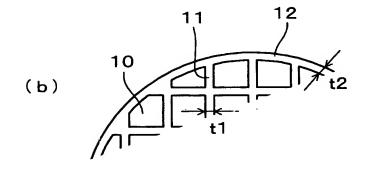
(図1)



[図2]

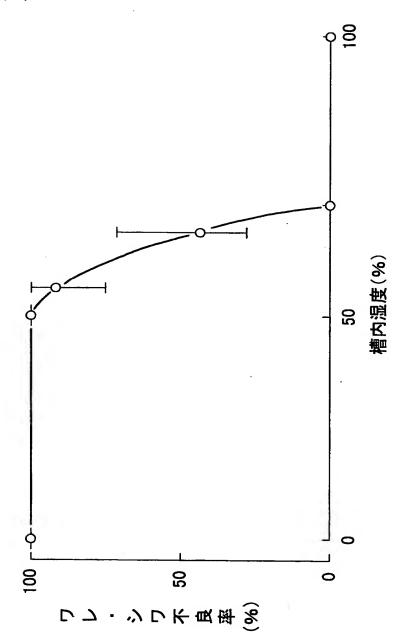






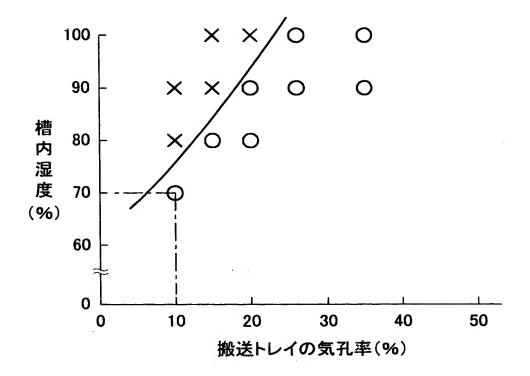
【図3】

(図3)



【図4】

(図4)

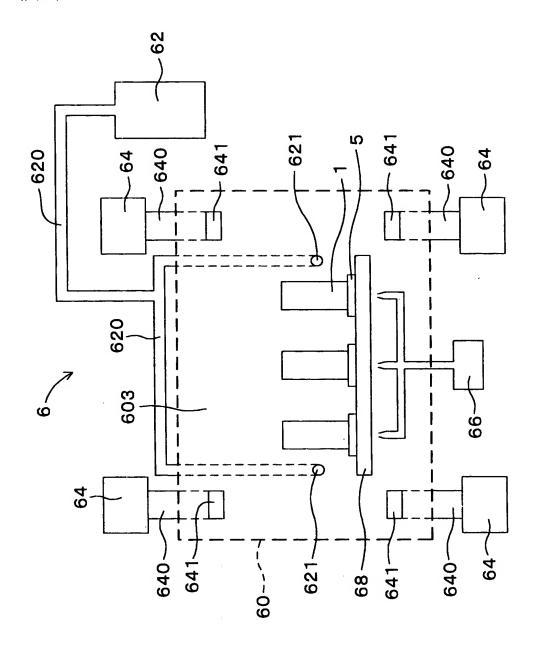


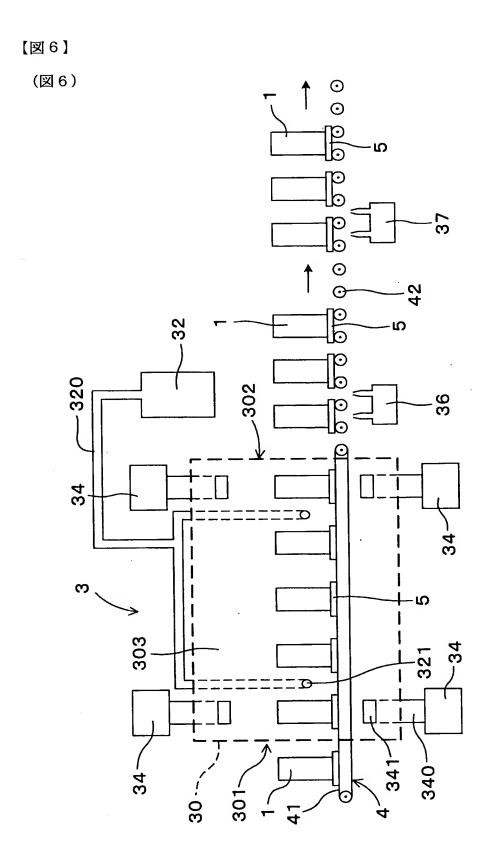
〇:成形体溶解なし

×:成形体溶解あり

【図5】

(図5)





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 セル壁厚さが 0. 1 2 5 mm以下のハニカム成形体を、外周スキン部に割れ、しわ等の欠陥を生じさせることなく乾燥することができるハニカム成形体の製造方法及び乾燥装置を提供すること。

【解決手段】 厚さ0.125mm以下のセル壁11をハニカム状に配して多数のセル10を設けたセラミック製のハニカム成形体1を製造する方法において、押出成形された粘土質のハニカム成形体1を乾燥するに当たり、ハニカム成形体1を湿度が70%以上の高湿度雰囲気に晒すと共に、周波数1000~10000MHz領域のマイクロ波を照射した後、さらに熱風乾燥を実施する。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000004260]

1. 変更年月日 1996年10月 8日

[変更理由]

名称変更

住 所

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

氏 名

株式会社デンソー